技術資料

量子メトロロジートライアングルの現状と基盤技術

岡崎雄馬* (平成26年12月25受理)

Quantum metrology triangle with cryogenic current comparators

Yuma OKAZAKI

Abstract

Quantum metrology triangle (QMT) experiment was proposed to verify the consistency between the three individual quantum phenomena used in the current electrical metrology, Josephson effects for the voltage standards, quantum Hall effects for the resistance standard, and single-electron tunneling effects for the current standard. An essential component to realize the QMT concept is a high-winding-ratio cryogenic current comparator (CCC) with a superconducting-quantum-interference-device (SQUID) used as a readout-circuit. Combining the CCC-SQUID-readout with QMT concept allows us to compare the three electrical quantities with extremely high accuracy that is otherwise unattainable. In this paper, current progress of the QMT experiments as well as the basic concepts of the SQUID and CCC are reviewed. Moreover, equivalent noise models of the SQUID and CCC are examined in order to understand the origin of the measurement uncertainty in the QMT experiments. This paper will provide a guideline for designing and constructing a measurement setup for the QMT experiment with unprecedented accuracy.

1 はじめに

電圧 V,抵抗 R,電流 Iの間に成り立つ関係式,V= RI はオームの法則として知られ,現在のエレクトロニ クスの基盤にもなっている重要な法則である.電圧と抵 抗の値は,ジョセフソン効果,および量子ホール効果と 呼ばれる量子現象によって得られる量子電圧,量子抵抗 を標準電圧・抵抗値として参照することで決定するこ とができる.これを量子電気標準と呼ぶ¹¹.残された電 流 I は VとRを使って I=V/R によって得ることが出来 るが,近年の科学技術の発展に伴って実現された単一電 子トランジスタを用いると,電流を構成する電子そのも のの流れを単一電子レベルで操作して究極精度の電流を 作り出す量子電流標準が実現可能である.この量子電流

*物理計測標準研究部門量子電気標準研究グループ

が実現すると電圧,抵抗とは全く独立な量子現象として 電流を作り出せることになる.この時,独立に作り出さ れた3つの電気量がオームの法則を満たすかどうかは 大変重要である.3つの電気量の間の整合性を検証する 実験は,量子メトロロジートライアングル (Quantum Metrology Triangle; QMT) と呼ばれ,今後の量子電気 標準の精度検証,およびその背景にある SI の改定にお いて極めて重要な意義があり,世界的に高い注目を浴び ている²⁾⁻⁴.

QMT 実験は,単一電子トランジスタによって生成した量子電流を量子ホール効果標準抵抗に流し,発生する 電圧をジョセフソン効果標準電圧と比較することによっ て行われる.扱っている法則はオームの法則であり,現 象としては容易に理解できるがその実行は容易ではない.現在実現されている単一電子トランジスタ素子で は,生成できる量子電流は高々数百 pA 程度の小さな値 であり,それを量子ホール素子に流して発生する電圧は 数10マイクロボルト程度の小さい値にしかならない. SIの改定に影響力を持つ QMTの検証実験では,7桁以 上の高い精度が必要とされており、このような小さな電 圧を7桁精度で測定することが困難だからである.こ の困難を克服し、7桁以上の精度でQMT検証実験を実 現するために、生成した量子電流を電流増幅器によって 精密に増幅し,得られる電圧値を大きくする方法が提案 され注目を集めている.このような高精密な電流増幅を 実現するために,超伝導量子干渉計(Superconducting QUantum Interference Device; SQUID) およびそ れを利用する極低温電流比較器 (Cryogenic Current Comparator; CCC) が用いられる.これらは超伝導の量 子効果を巧みに利用した量子計測器と呼ぶことが出来る ものであり,今日そして将来の量子電気標準を陰で支え る重要な基盤技術である5)-6).本調査研究の目的は,第 ーに QMT の現状を俯瞰し, 現在の進捗をまとめること. 第二に、トライアングルの検証で重要になる SQUID と CCCの原理,およびこれまでの先行研究を調査し,さら なる高精度化への知見を得ることである.特に後者に関 しては、目標である7桁精度のQMT実験を実現するた めに,その不確かさの要因である電気雑音モデルなど理 論研究をまとめた.これらの知識は今後,高精度な計測 器を実現し QMT 実験を成功に導くうえで重要な指針と なる.

本報告書の構成は以下である.まず第2章で,QMT の構成要素であるジョセフソン素子,量子ホール素子, 単一電子トランジスタ素子の3つの動作原理を簡単に説 明し,それらを組み合わせて行うQMT実験の方法を説 明する.続いて,3章で基盤技術であるSQUIDとCCC の原理を説明し,先行する理論研究などで明らかとなっ ている不確かさの要因などを紹介する.最後に雑音モデ ルからQMT実験の不確かさに関する考察を行った.4 章でそれらをまとめる.

2. 量子メトロロジートライアングル実験の現状

QMT 実験では,3つの電気量にそれぞれ対応する量 子現象を組み合わせて行う.まず,3つの量子現象を説 明し,それらを組み合わせて行うトライアングルの実験 方法について説明する.

2.1 現在の SI における電気単位の現状と課題

現在の SI では,電流単位であるアンペアが基本の7 つの単位に定められている⁷⁾. それによると,1アンペ アは「真空中に1メートルの間隔で平行に配置された 無限に小さい円形断面積を有する無限に長い二本の直 線状導体のそれぞれを流れ,これらの導体の長さ1メー トルにつき2×10⁻⁷ニュートンの力を及ぼし合う一定 の電流である」と定義されている(図1).しかし,こ の定義とおりに電流を作ろうとすると,無限に長い導体 などの実現困難な要素が含まれており,この方法で1ア ンペアを作り出すことは実用的ではない.実際この定 義は,1アンペアを作ることを念頭において定義された わけではない.上述の定義は古典電磁気学におけるアン ペールの法則と,ローレンツ力によって理解することが でき,式で表すと,

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}$$
(2.1)

と書ける.ここで, Fは2本の直状導体間に働く力, Lは その長さ, I, I₂はそれぞれの導体を流れる電流であり, μ_0 は真空の透磁率である.この式と上述の定義を比較 すると,電流の定義は真空の透磁率を μ_0 =4 $\pi \times 10^7$ H/ mと定義している式であることがわかる.現在のSIでは, 光速度 c,真空の透磁率 μ_0 などの 19 世紀までに確立した 古典電磁力学で重要な基礎物理定数が,不確かさのない 定義値として定められており,定義値を基に電流を定義 しようとすると上述のSIの表現に帰着される.現状では, 上述の SI に忠実に電流を実現することはされず,代わり に後述する量子現象を基準として,抵抗と電圧を測定す ることができる.残された電流は,オームの法則を介し て電圧と抵抗によって作り出すことができる.



図1 現在のSIにおける1アンペアの定義.古典電磁力学におけるアンペールの法則とローレンツ力によって電流を定義する.

量子現象を基準とした電圧,抵抗の測定は,既に産総 研を含む世界各国の計量標準機関で国家標準として採用 されるなど,量子電気標準として確立している.古典電 磁気学に基づいている現状の SI は実際の状況に沿って 改定されようとしており,2018年以降にSI単位系を大 きく変更する再定義の実施が予定されている⁸⁾.具体的 には,素電荷 e やプランク定数 h などの量子現象の組み 立て量となる物理量を不確かさのない定義値として定め る.これにより量子電気標準の抵抗,電圧などの値は自 然な形で SI に組み込まれることになる.この再定義に おいて,現在質量原器を基準とした質量標準や,水の三 重点を基準とする温度標準などもより先進的・現代的な 定義に置き換わる予定である.新SI(あるいは量子現 象に基づく量子 SI) でアンペアはどのように定義され るのか? 文献⁸⁾ からそのまま引用すると "the ampere will continue to be the unit of electric current, but its magnitude will be set by fixing the numerical value of the elementary charge to be equal to exactly 1.60217X $\times \ 10^{^{-19}}$ when it is expressed in the SI unit s A, which is equal to C"のように素電荷eの値と時間周波数によっ て高精度に計測できる秒の単位を用いて定義される.本 報告書で紹介する単一電子トランジスタによる量子電流 の生成は,この定義に忠実を実行して電流を作り出す方 法である.当然その量子電流は,量子電圧,量子抵抗と オームの法則を介した整合性が成り立っていなければ ならない.上の引用文で素電荷eの値の7桁目はXと なっており、その値は未定である.最終的な値は科学技 術データ委員会(Committee on Data for Science and Technology; CODATA) による値の調整を参照して決定 されることになる.本報告書で調査対象とする QMTの 実験もその値を左右する影響力を持っている.しかし、 Xは素電荷の7桁目であり、そこへ寄与するために、少 なくとも7桁以上の精度でQMT実験が実現されなくて はならない.

2.2 量子電気標準における電圧,抵抗,電流

2.2.1 ジョセフソン効果による量子電圧

電圧標準に用いられるジョセフソン効果は,図2(a) のような2つの超伝導体で数ナノメートル程度の薄い 絶縁体または常伝導体を挟んだ構造(ジョセフソン接合) で観測される量子現象である^{9),10)}.超伝導は極低温に 冷却した金属の電気抵抗が零になる量子現象である.超 伝導の発現する温度(転移温度Tc)は材料ごとに異なっ ており,単金属ではニオブ(Tc = 9.2 K)や鉛(Tc = 7.2K),合金としては窒化二オブ(Tc = 16 K)などが良く 知られている.ジョセフソン接合は,半導体微細加工な どで用いられるナノ加工手法,すなわち金属膜蒸着や フォトリソグラフィーなどを用いることによって作製で きる.超伝導体間に挟む絶縁体としては,アルミを酸素



図2 量子電圧標準に用いられるジョセフソン接合.(a) 2つの超 伝導体(S)を薄い常伝導金属(N)で挟んだ構造.常伝導 金属層の厚みは数ナノから数10ナノメートル程度.右側記 号はジョセフソン接合の回路記号.(b) A Cジョセフソン効 果の測定セットアップ.(c)ジョセフソン素子を直列に並べ たプログラマブルジョセフソン接合アレー.

に曝してできる自然酸化膜が良く用いられ,金属体としては TiN などが用いられる.どちらの場合でも,2つの 超伝導体が非超伝導体層を介して弱く接続されているこ とが本質的な役割を担う.図2(b)のようなセットアッ プを用いて,ジョセフソン接合に交流電流(周波数は数 GHz から数+GHz 帯域のマイクロ波)を流すと素子に 直流電圧 V₄ が発生する.この現象はAC ジョセフソン 効果と呼ばれ,発生する電圧 V₄ は,

$$V_{\rm J} = n f_{\rm J} / K_{\rm J} \tag{2.2}$$

で与えられる.この時 f_J は素子に与えている交流電流の 周波数であり, K_J はジョセフソン定数,nは整数である. K_J は理論的に,

$$K_{\rm J} = \frac{2e}{h} \tag{2.3}$$

と与えられており, $e \ge h$ はそれぞれ素電荷およびプラ ンク定数である. K_{J} の値としては 1990 年に定められた 協定値 ⁷⁾,

$$K_{\rm J-90} = 483597.9 \; {\rm GHz/V}$$
 (2.4)

が用いられている.この協定値は不確かさのない定義値 であり,その意味で8桁目に不確かさを持つ*e*,*h*から定 義される式(2.2)の値とは本質的に異なっている.不 確かさのない協定値が導入された背景は,ジョセフソン 効果自身は非常に普遍的に成り立っている現象であるこ とが上げられる.実際ジョセフソン効果に関して,同じ 接合同士¹¹⁾,あるいは異なる構造¹²⁾で作られた接合間

産総研計量標準報告 Vol.9, No.3

で比較するなどの実験が行われ,最大で19桁精度での 一致が報告されている^{13),14)}.この様にジョセフソン効 果自身は高い精度で成り立っており,電気測定の範囲内 で閉じた比較測定を行う限りにおいては,不確かさのな い定義値を用いることでより高い精度での議論が可能に なるなどの利便性が得られる.

ジョセフソン効果に基づいた電圧発生において,理論 上はマイクロ波周波数を変えることによって任意の電圧 を発生できるはずである.実用的なマイクロ波の発生源 としては1GHz~100GHzの帯域が用いられているが、 マイクロ波の周波数を変化させることはインピーダンス 整合など高周波回路としての技術的な困難が伴うため, 周波数変化の自由度はそれほど高くない.この様な制限 を克服するために, 複数のジョセフソン接合を直列に集 積化したプログラマブルジョセフソン素子が開発されて いる.図2(c)のように,1,2,4,…2^{N-1}と2の倍数で接 合を直列に接続しそれぞれに独立した駆動電流源を接続 する.ジョセフソン効果では,直流のオフセット電流を印 加したところだけで電圧を発生させることが可能なので、 2進法にしたがって1個から2^N1個までの任意の個数の 接合の組み合わせを自由に切り替え可能である. 電圧状 態になる接合数(電圧を発生する接合数)を変化させて 発生電圧のレンジを切り替え,かつマイクロ波周波数の 微調整を行えば発生電圧値を幅広い範囲で高精度に制御 できる.また、レンジの切り替えを動的に行うことによっ て正弦波を発生させるなどの応用も可能である.現在で はこの方法で、50万以上の素子を集積化することによっ て 10 V レンジの電圧標準が実現されている^{9),10)}.

2.2.2 量子ホール効果による量子抵抗

量子ホール効果は高移動度二次元電子ガスを低温(通 常は液体ヘリウム温度以下)に冷却し,磁場を印加した 際にホール抵抗が量子化される現象である¹⁵⁾.もとも とホール効果は,金属薄膜などに磁場を印加した際に, キャリアが磁場によるローレンツ力で曲げられて,電流 と直行する方向に電圧が発生する現象であり,古典的に ホール抵抗は磁場に比例するだけである.異なるバンド ギャップを持つ半導体の接合(ヘテロ接合)において, 界面に電子が閉じ込められ界面に沿った二次元面内での みを移動できる状態が作られる.特にGaAs/AlGaAsな どの化合物半導体を残留不純物の極めて少ない超高真空 中で分子線エピタキシー成長して作製されるヘテロ構造 では,電子が数ミクロンスケールにわたって散乱されず に伝導可能な高移動度二次元電子ガスが実現される.そ の様な,高移動度の二次元電子ガスに強磁場を印加する と、ローレンツ力で曲げられた電子の円運動(サイクロ トロン運動)が量子化されることによって、ホール抵抗 に一定の抵抗値が発現する.



図3 量子抵抗標準に用いられる量子ホール効果.(a)量子ホール 効果の測定に用いられるホール素子.(b)ホール抵抗(左) と縦抵抗(右軸)の磁場依存性.量子ホール効果によるホー ル抵抗プラトーと縦抵抗のゼロ抵抗状態が観測されてい る.測定は大江氏(産総研)による.

ホール抵抗の測定は、図3(a)に示したようなホール バー構造に長手方向に電流 I を流し、そのとき発生する 縦電圧 Vxx、横電圧(ホール電圧)VHを測定すること によって行う.電流電圧から、縦抵抗 Rxx = Vxx/I とホー ル抵抗 RH = VH/I を、磁場を変えて測定すると図3(b) に示したような、ホール抵抗に階段状の抵抗ステップが 観測され、その時縦抵抗がゼロ抵抗状態になっている様 子が見られる.これが量子ホール効果である.量子ホー ル効果の抵抗値 RH は、

$$R_{\rm H} = \frac{R_{\rm K}}{i} \tag{2.5}$$

で与えられ, $R_{\rm K}$ はフォン・クリッツィング定数,iは整数である.図中で10T付近に現れているのはi=2の量子化抵抗であり,量子抵抗標準として用いられている.理論的には $R_{\rm K}$ は,

$$R_{\rm K} = \frac{h}{e^2} \tag{2.6}$$

で与えられる¹⁷⁾.標準抵抗としては,i = 2の第二プラ トーが標準抵抗として用いられ,その抵抗値は約12.9 k Ωである. $R_{\rm K}$ の値もジョセフソン効果と同様に1990年 の協定値で定義値として定められており⁷⁾,

$$R_{\rm K-90} = 25812.807\,\Omega\tag{2.7}$$

が用いられている.

AIST Bulletin of Metrology Vol.9, No.3

量子ホール効果自体は,測定温度や磁場の正確さには 依存しない普遍性の高い現象であり、ガリウムヒ素へ テロ構造上に形成された2つの素子抵抗や他にもSi-MOSFET 構造で作成されたホール素子抵抗を比較した 実験では10桁以上の高い精度で整合していることが検 証されている^{15)・18)}.これまでは,ガリウムヒ素基板を 用いた量子抵抗素子が中心的な役割を担ってきたが,近 年グラファイトを原子一層の厚みで取り出して作られる 原子膜であるグラフェンにも高品質な二次元電子ガス が形成され、量子ホール抵抗標準の観点からも注目が集 まっている.現在国家標準に多く採用されているガリウ ムヒ素ヘテロ構造から作られた量子ホール抵抗素子とグ ラフェンから作られた量子ホール抵抗素子の抵抗値を比 較する実験が行われ,8桁以上の精度で2つの抵抗値が 一致していることが示された¹⁹⁾.この結果は,量子ホー ル効果が材料に依存しない普遍的な現象であることを実 証したことに加え、グラフェンが今後の抵抗標準に用い ることが出来る有望な素子材料であることを示唆してい る. グラフェンを用いるメリットとしてはいくつかあげ られる.第一に,高品質なガリウムヒ素へテロ構造の作 製には高額な分子線エピタキシー装置を用いて熟練の職 人が成長することで初めて可能になる一方, グラフェン は市販の高品質グラファイトから容易に剥離して得ら れ,作製コストが大幅に抑えられる.第二に、グラフェ ンは室温においても高移動度の二次元電子ガスを形成で きるため,室温においても量子ホール効果が観測されて おり、将来的には抵抗標準素子として極低温に冷却する 必要がなくなる可能性がある²⁰⁾.第三に,近年グラフェ ンに特定の引っ張り歪を印加するとゲージ場に伴う有効 的な擬磁場が発生し,超伝導電磁石による外部磁場を与 えなくても,量子ホール効果が発現する可能性が理論的 に予言されている²¹⁾.実際,走査トンネル顕微鏡を用い た実験では, 歪によって磁場 300 テスラに相当する擬磁 場が発生することが実験で確認された²²⁾.まだ,歪によ る量子ホール効果の発現は観測されていないが、今後の 実験で歪による量子ホール効果が確認されれば大きなブ レークスルーになると予想される.特に、素子の冷却に 用いられる冷凍機や強磁場の印加に用いられる超伝導磁 石には液体ヘリウムなどの寒剤が大量に必要であるが、 液体ヘリウムは高価であることに加え,近年,需要増に 伴う価格の高騰などもあり入手困難な状況が起きてい る. グラフェンの有効磁場による量子ホール効果が, 室 温で実現されるようになれば,高価な実験装置の不要な 簡便な量子ホール抵抗標準が実現され,量子電気標準の 大きな発展が期待される.この意味で、グラフェンは次 世代の量子抵抗標準の可能性を秘めたデバイスとして盛 んに研究されている.

2.2.3 単一電子トランジスタによる量子電流

電流は単位時間当たりに流れた電気量で定義されてい る. 電流を運んでいるのは素電荷 e = 1.60217657 × 10 ¹⁹ C の電気量を持つ電子であるため,単位時間当たりに 流れる電子の個数を精密に制御することによっても任意 の電流を作り出せるはずである.近年ナノテクノロジー の発展に伴い、電子を一個の単位で制御できる単一電子 トランジスタが実現され,単一電子レベルで電荷を操作 できる様になった.近年,この単一電子トランジスタを 用い単一電子レベルで正確な電流標準を作ろうとする取 り組みが注目を集めている.特に欧州では,NPL,PTB などといった欧州各国の計測標準研究機関が連携した共 同プロジェクト "Quantum ampere: Realisation of the new SI ampere"が 2012 年から 2015 年に実施され,量 子電流標準の実現に向けた研究を精力的に行った、プロ ジェクトの目標は、QMTの実験に必要な7桁精度で量 子電流を実現するために「100 ピコアンペア以上の電流 量で7桁以上の精度」を実現することである.実現を目 指す研究としては、以下の3つの重点課題をとりあげて いた.(1) 単一電子トランジスタとしてそれまでに提 案されている素子構造,単一電子制御メカニズムを比較 検討し,高精度な電流標準素子を実現する研究,(2)単 一電子制御で得られる電流量が微小であるため、そのよ うな微小電流を高精度に評価できるための測定技術を開 発する研究、(3) 最後に(1) と(2) を組み合わせて 行う精度の評価,量子抵抗および量子電圧を介して作り 出される電流との整合性の検証(すなわち QMT 検証実 験)である.現在,精密測定手法がかなり確立している 量子抵抗,量子電圧標準とは異なり,後発の量子電流標 準はピコアンペア以上の出力電流レンジにおいて高々6 桁程度の精度が現状であり、QMT 実験の実現には、高 精度な量子電流標準の実現が要である.その意味で,現 状の QMT の実現に向けた研究の発展は,電流標準素子 の精度向上の研究であるといっても過言ではない.量子 電流標準の研究に関しては,中村による過去の調査研究 23) に詳しく記述されている.本調査研究では、そこで 触れられなかった精密測定方法など基盤技術に関して詳 しく記載する.以下では、単一電子トランジスタの構造 に関して簡単に記述する.

図4 (a) に単一電子トランジスタ素子 (SET) の基本的な構造を示した.SET は2つのトンネル障壁を数 百ナノメートル程度の微小な領域に加工した構造であ る.2つのトンネル障壁にはさまれた微小領域が,数百 ナノメートル以下に小さくなると,微小領域の自己静電 容量Cは数十アトファラッド程度まで小さくなる.この 時,微小領域に電気量eの電子をひとつ追加するのに必 要なエネルギーは、

$$U = \frac{e^2}{2C} \tag{2.8}$$

によって計算され,数meV程度以上の値になる.こ のエネルギーは10K程度の熱エネルギーに相当するため,素子をこれよりも十分低温に冷却(通常希釈冷凍機を用いて数十ミリケルビン程度に冷却)すると微小領域内の電子数はもはや熱的にゆらぐことはなくなる.電子を閉じ込めているポテンシャルをゲートに印加する電圧によって制御することによって,この電子数を自由に制御可能である.この素子を利用することによって,例えばソース電極から微小領域に電子を一個取り込み,それをドレイン電極へと送り出すと言う単一電子転送が可能になる.このゲート電圧の転送周期を,正確な周波数 f_{ser} で行うことによって結果として流れる電流量は,

$$I_{\text{SET}} = ef_{\text{SET}} \tag{2.9}$$

となり,周波数と素電荷を組み立て量として電流が生 成されることになる.

図4(b)は、ガリウムヒ素ヘテロ基板上に電子線リ ソグラフィーでショットキー電極を加工することによっ て形成される単一電子トランジスタ素子の模式図であ る.このヘテロ基板には、表面から数十ナノメートル下 に二次元電子ガス(2DEG)が形成されており、電子は 二次元的に自由に動き回れる状況である.表面のショッ トキー電極に負電圧を印加すると、ゲート直下に静電ボ テンシャルが印加され伝導電子の存在しない空乏領域 が作られる.これによって電子が数百ナノメートルの領 域に閉じ込められた状態が形成される.この閉じ込め状 態と閉じ込められていない 2DEG の間には静電ポテン シャルが形成されており、このポテンシャルをトンネル 障壁として利用することにより単一電子トランジスタ構 造が実現できる²⁴⁾.

単一電子転送方式による量子電流で、電流精度を悪化 させる要因は転送エラーである.これは本来電子を1個 ドレイン電極に送り出すタイミングで、電子が複数個送 り出されたり(コトンネリング),逆側のソース電極に 押し戻されてしまったり(バックトンネリング)するこ とによって最終的に転送された電子数が正確でなくな ることによる.トンネルの時間スケールを非常にゆっく りすることで、転送エラーを抑えることが出来るが、得 られる電流値が少なくなってしまうという問題がある. 単一電子転送速度は、トンネル障壁のトンネルレートな どによってリミットされており、これまでの実験報告が あるのは、高々数 GHz 程度までである.この転送速度 は、数 100 ピコアンペア程度の電流を出力することに相 当する.さらに大きな電流を得るために、素子を並列に 並べた並列ポンプなどが研究されており、10 個程度の 並列転送が実証されている.更なる並列化には、特性の そろった SET 構造を実現するためのナノ加工技術など の研究開発が必須であり、今後の研究の発展に注目が集 まっている.



図4 量子電流標準に用いられる単一電子転送.(a)単一電子トランジスタ構造の概念図.(b)チューナブルバリア単一電子トランジスタ素子の模式図.ショットキー電極に負電圧を印加し2DEGを空乏化させ電子の閉じ込め状態を形成する.

2.3 3つの量子現象を組み合わせた量子メトロロジー トライアングル

2.3.1 量子メトロロジートライアングル実験の目的

既に述べたようにジョセフソン電圧標準,量子ホール 抵抗標準では不確かさのない協定値を利用して量子電 気標準の中である意味閉じた体系を持っている.それら が,他の SI とどのように整合しているかどうかは,式 (2.2),(2.5)を精密に検証するしかない.3つの量子 電気標準で与えられる定数が,その理論値からずれてい たと仮定する.すなわち,

$$\begin{split} K_{\rm J} &= \frac{2e}{h} \left(1 + \varepsilon_{\rm J} \right) \\ R_{\rm K} &= \frac{h}{e^2} \left(1 + \varepsilon_{\rm H} \right) \\ Q_{\rm SET} &= e \left(1 + \varepsilon_{\rm SET} \right) \end{split} \tag{2.10}$$

のように微小な補正値 ε_J , ε_K , そして ε_{SET} によってその 記述されるだろう.ここで Q_{SET} は単一電子転送で運ば れる電気量を表す.この時,それぞれの量子現象で得ら れる量子電圧,量子抵抗,そして量子電流の値は,

$$V_{\rm J} = n \frac{h}{2e(1+\varepsilon_{\rm J})} f_{\rm J}$$

$$R_{\rm J} = \frac{h}{ie^2} (1+\varepsilon_{\rm H})$$

$$I_{\rm SET} = e(1+\varepsilon_{\rm SET}) f_{\rm SET}$$
(2.11)

である.QMTでは、オームの法則を介してこの補正値 の大きさを評価する.通常電圧標準として用いられるの は最初の電圧プラトー (n = 1) であり、抵抗標準とし ては第2プラトー (i = 2) である.それを考慮して、V= RI に上式を代入して整理すると、

$$\frac{J_{\rm J}}{f_{\rm SET}} = 1 + \varepsilon_{\rm J} + \varepsilon_{\rm K} + \varepsilon_{\rm SET}$$

である.ここで補正値は1よりも小さいため2次以上の 項を消去した.すなわち,オームの法則を介して3つの 電気量が釣り合った時の,ジョセフソン素子を駆動する 周波数 f_{J} とSETを駆動する周波数 f_{SET} の間のずれを高 精密に測定することによって,3つの量子電気標準の理 論値からのずれ $\epsilon_{J}+\epsilon_{K}+\epsilon_{SET}$ を評価することが出来る.し かし次の節で詳しく述べるように,この3つの電気量の 比較を7桁以上の精度で行うには電気回路的な工夫を 凝らさなければならない.

2.3.2 量子メトロロジートライアングルの実現回路

QMT の実験方法を図5に示した.いずれの図でも, SET によって生成した量子電流 I_{SET} を量子ホール素子, あるいはそれを基準に値を校正した抵抗器に流し込み, 発生する電圧をジョセフソン電圧標準と比較する.問題 は, I_{SET} が高々数百ピコアンペア程度と微小であるため 発生電圧が小さく,高精度な比較が困難であることであ る.簡単な見積もりとして,100 pAの電流を $R_{\text{K}} \approx 12.9$ k Ω に流し込むと,発生電圧は約1.29 μ V 程度である.電 圧の比較には通常差動電圧計が用いられるが,その分解 能はナノボルト程度であるから,3 桁程度でしか比較を 行うことが出来ない.これでは積算平均によって不確か さを小さくしようとしても,1 億回の繰り返し測定が必

要であり、1回の測定が1分程度と仮定しても190年間 測定を続ける必要があり,現実的な時間で7桁を達成で きない.そのため7桁以上を目標とするQMT実験には, 発生電圧が大きくなるように工夫が必要になる.1 nV の分解能の電圧比較で,7桁の精度を出すためには,発 生電圧は 10 mV 程度必要である.そのため,量子抵抗 器の代わりに、その1万倍の抵抗値である100 MΩ以上 の抵抗器を用いて,測定する方法が提案されている[図 5(a)]. しかし, 抵抗値が 100 MΩ程度の抵抗レンジに なると、抵抗値そのものを校正する際の不確かさが大き くなってしまい,現状では6桁程度での不確かさが上限 である.このような高抵抗領域における抵抗校正技術が 1桁向上すれば,高抵抗を用いたQMT実験が可能にな る.別の方法として,図5(b)に示したのは,pF程度 の小さな容量のキャパシタに SET 電流を充電し, 発生 電圧を測定する方法がある.電流が1pAでも1pFの キャパシタに1秒間溜め込めば、1Vの発生電圧を生み 出すことが出来る.実際この方法を用いて,QMT実験 を試みる研究が NIST^{25) -28)} や PTB^{29),30)} で行われ, 最 大で 0.9 × 10⁻⁶ の精度で QMT を検証した.この方法で は、キャパシタを校正する際に交流測定が必要になるな ど技術的に高度な測定であり,また,校正には寄生容量 などを取り入れた等価回路を立てる必要があるなど人為 的な要因が入り込みやすい.この方法では、微小キャパ シタの精度向上が重要であるが現状では6桁精度での 測定が上限である.



図5 量子メトロロジートライアングルの実験セットアップ.(a) は高抵抗な標準抵抗器を用いて行う間接的な方法.(b)は 微小なキャパシタをインピーダンス測定によって値を校正し て行う間接的な方法.(c)は電流増幅器を用いて量子電流 値を増幅し,直接量子ホール抵抗標準との値の比較を行う直 接的な方法.

最後に、電流増幅器を用いて SET からの量子電流そ のものを1万倍以上に増幅し,発生電圧を大きくする方 法を紹介する[図5(c)].この方法では、電流増幅する 際の増幅率の精度が実験の精度に直接関わってくる. そ のような高い精度での電流増幅は、通常のエレクトロニ クス回路を用いる電流増幅回路では実現不可能である が、以降の章で説明する極低温電流比較器と SQUID に よる読出し装置を組み合わせることによって9桁以上 の精度で正確な電流増幅が可能になる.現状ではこのよ うな精密電流増幅装置を用いて行う QMT 実験が有望視 されている.図6に電流増幅器である CCC と SQUID 読出しを使った QMT 実験セットアップを示す. CCC は2種類の巻き数比N1:N2を持ったコイルであり、そ れぞれのコイルを流れる電流 I1 と I2 に, その巻き数を 乗じた値, すなわち N_1I_1 と N_2I_2 のバランスを検出する 電流比較器である.超伝導の性質を利用するため超伝導 転移温度以下の低温環境で動作させる必要があり,極低 温の名を冠している.電流のつりあいの検出は SQUID による磁場測定によって行われ, SQUIDの出力がゼ ロになるとき、電流と巻き数の積が釣り合う.例えば N₁:N₂=10000:1の巻き数比で CCC を作製すれば電流比 I₁:I₂=1:10000 で釣り合うことになる. 電流バランスの 検出感度は現実的な積算時間(数時間のオーダー)で aA レベルの分解能に達するため 100 pA の電流に対し、 8桁の精度を持たせることができる.このような電流比 較を利用して増幅を行う際には, SQUIDの出力がゼロ になるようにフィードバック電流を流して行う.図6に 示したように SET からの量子電流を CCC の高巻き数 側コイルに流す.この時,SQUIDの出力をモニターし、 それがゼロになるようなフィードバック電流を低巻き 数側のコイルに流す.SQUIDの出力がゼロになった時 フィードバック電流は正確に SET 電流に巻き数比の分 だけ増幅されたことを意味し,その電流を量子ホール素 子に流して発生電圧をジョセフソン電圧標準と比較でき る.巻き数比が1万以上になるような CCC を作製する 事で,QMT実験で必要な精度を達成できる試算である. ここでみたように, CCC と SQUID は, 異なった測定レ ンジにある量子電流と量子電圧,抵抗間の橋渡しをする QMT 実験の基盤技術である.まだ CCC を利用する完 全な QMT 実験は実現されていないが, 10 kΩの標準抵 抗を用いた原理の実証が LNE で行われ,6 桁程度の精 度を達成した報告がされている³¹⁾.



図6 極低温電流比較器(CCC)を利用した直接QMT実験のセットアップ.単一電子トランジスタ素子(SET)によって生成された量子電流をCCCで増幅し、量子ホール素子へ流し発生したホール電圧をプログラマブルジョセフソン素子で発生する電圧と比較する(ゼロ点検出器による).CCCおよびSQUIDが比較を行う上で重要な役割を担う.

3. 量子メトロロジートライアングルの基盤技術

3.1 超伝導量子干涉計(SQUID)

前章で説明したように SQUID は極低温電流比較器を 用いた電流比較を行う際の読出し装置として用いられ る.CCC における電流比較の精度はこの SQUID の読 み出し感度にかかっているといっても過言ではない.文 献^{5),6),32)}を参考に SQUID に関する基本原理を説明す る.SQUID は電圧標準に用いられるジョセフソン接合 を利用したデバイスであり,超伝導ループに接合を2つ 有する dc-SQUID と1つの接合を有する rf-SQUID に 大別される.いずれもループを貫く磁束を出力電圧に変 えて高感度に検出するセンサーであるが,より高感度な dc-SQUID を中心に説明する.まず,基本的な原理を説 明し,測定方法を説明する.



図7 SQUIDの構造.ループを形成した超伝導体に、ジョセフソン接合(図中斜線部分)を2つ加工し、dc-SQUIDと呼ばれる.ループに電流を流したとき、ループを貫く磁束Φ ext に依存する電圧 V が発生する.

3.1.1 dc-SQUID の動作原理

dc-SQUID は図7に示すような,超伝導体からなる ループ構造に2つのジョセフソン接合を埋め込んだ素子 である.SQUIDを用いた測定では、ループ構造に電流 を流し,発生する電圧 Vを計測する. V はループの部分 を貫く磁束 Φ_{exp} に依存するため, SQUID は磁束を電圧 へと変換する変換器である.磁束電圧変換はそれぞれの 記号をとっФ-V変換と呼べる. SQUID の動作原理を理 解するためにまずは,図8(a)に示した単一ジョセフ ソン接合の電流電圧特性(IV 特性)を等価回路モデル である Resistively and Capacitively Shunted Junction (RCSJ) モデルに基づいて考察する.このモデルでは、 ジョセフソン接合を図8(b)に示すような臨界電流 I., 常伝導抵抗成分 R_N,接合容量 C_Jの並列結合回路によっ て近似的に説明するが,その電気的な特性をかなり正確 に再現できる. R_Nは接合の常伝導抵抗成分であり,接 合が非超伝導状態(例えば移転温度以上)における IV 特性から測定されるものである.C₁は2つの超伝導体 間で働く寄生容量に相当し,主には接合断面積Aと接合 の厚み d, 非超伝導層の誘電率 ε から並行平板コンデ ンサを仮定して $C_{I} \approx A \varepsilon / d$ から見積もられる. i_{s}, i_{R}, i_{C} はそれぞれの要素を流れる電流成分であり, 接合を流れ る正味の電流はキルヒホッフ則より I=is+iR+ic である.



図8 ジョセフソン接合の等価回路モデル(RCSJモデル)と電流 電圧特性.(a) SNS タイプのジョセフソン接合の構造.(b) ジョセフソン接合の RCSJモデル.(c) ジョセフソン接合の V-I 曲線.臨界電流 Ic を超えた電流を流すと接合が電圧状態 となり,直流電圧が発生する.

超伝導は巨視的量子効果であり,その状態は位相に よって記述される.特にジョセフソン接合は2つの超伝 導体が弱く結合しており,接合を介した二つの超伝導体 位相差が伝導現象を記述するパラメータである.時刻 たおける位相差を φ (t)とすると,接合両端における電 流電圧は次の2つのジョセフソン方程式によって記述 される.

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = \frac{2e}{\hbar}V(t), \qquad (3.1)$$

$$i_{\rm S}(t) = I_{\rm C} \sin \varphi(t) \tag{3.2}$$

ここで、V(t) は接合に発生する電圧, i_s は超伝導電 流成分であり、 $\hbar = h/2 \pi$ である. $I < I_c$ の時、 φ (t) =const. であり発生電圧はゼロである.このことは、接 合を流れる電流が臨界電流以下では、電流はすべて散逸 のない超伝導電流 i_s によって運ばれ、電圧が発生しない ことを意味する. $I > I_c$ では、超伝導電流だけでは電流 を運びきれないため、接合両端に電圧が発生し、それに よる常伝導電流が、抵抗成分とキャパシタンス成分を流 れる.それらは、

$$i_{\rm R}(t) = \frac{V(t)}{R_{\rm N}} = \frac{\hbar}{2eR_{\rm N}} \frac{d\varphi(t)}{dt}, \qquad (3.3)$$

$$i_{\rm C}(t) = C_{\rm J} \frac{dV(t)}{dt} = \frac{\hbar}{2e} C_{\rm J} \frac{d^2 \varphi(t)}{dt^2}$$
 (3.4)

の様に超伝導位相差と対応付けられる.以上の電流成分 をまとめると、

$$\frac{\hbar}{2e}C_{\rm J}\frac{d^2\varphi(t)}{dt^2} + \frac{\hbar}{2eR_{\rm N}}\frac{d\varphi(t)}{dt} + I_{\rm C}\sin\varphi(t) = I$$
(3.5)

がえられ、この方程式によって RCSJ モデルにおける電 流電圧特性が記述される.ここで通常のサブミクロン程 度の断面積のジョセフソン接合では、 $C_J \approx 1$ fF 程度であ り、現在の議論においては無視できる程度の寄与しかも たない.したがって C_J の寄与を除いた以下の近似的な 式 (RSJ モデル)

$$\frac{\hbar}{2eI_{\rm C}R_{\rm N}}\frac{d\varphi(t)}{dt} + \sin\varphi(t) - \frac{I}{I_{\rm C}} = 0 \tag{3.6}$$

によって比較的正確にジョセフソン接合の動作を理解で きる.この一階の微分方程式は,積分公式に基づいて解 くことができ,

$$\varphi(t) = 2 \tan^{-1} \left[\sqrt{1 - \frac{I_{\rm C}^2}{I^2}} \tan \left(t \frac{eI_{\rm C}R_{\rm N}}{\hbar} \sqrt{\frac{I^2}{I_{\rm C}^2} - 1} \right) + \frac{I_{\rm C}}{I} \right]$$
(3.7)

である.この表式は複雑な形をしているが,周期

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{I^2}{I_{\rm C}^2} - 1}} \frac{\hbar}{2eI_{\rm C}R_{\rm N}}$$
(3.8)

の関数であることがわかる.SQUIDの測定では,この 周期よりもずっと遅い直流成分の電圧計測を行うため, 今興味があるのは平均的な電圧値である.平均値を得る ために,V(t)を1周期にわたって平均すると,

$$\langle V \rangle = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} V(t) dt = \frac{\hbar}{2eT} \int_{0}^{T} \frac{d\varphi}{dt} dt = \frac{\hbar}{2eT} [\varphi(t) - \varphi(0)] = \frac{\hbar}{2eT} (3.9)$$
 である.これに,先ほどの周期を代入すると,平均的な
電圧値として

$$\left\langle V \right\rangle = I_{\rm C} R_{\rm N} \sqrt{\frac{I^2}{I_{\rm C}^2} - 1} \tag{3.10}$$

である.ここで,位相差が1周期で2π変化する性質を 用いた.この結果を図示したものが図8(c)である.臨 界電流よりも小さな電流が流れている時,超伝導電流に よってゼロ電圧状態であるが,臨界電流を超えた時,両 端に電圧が発生している様子が見られる.

次に,実際の SQUID 構造を理解するために,ジョセ フソン接合がループ構造に2つ埋め込まれた図9(a) のような構造に対して RCSJ モデルに基づく考察を行 う.SQUID の電流電圧特性は,2つある接合それぞれ において両端での超伝導位相差 φ_1, φ_2 からなる連立微分 方程式,

$$V = \frac{h}{2e} \left(\frac{d\varphi_1}{dt} + \frac{d\varphi_2}{dt} \right)$$

$$2\pi n = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0} - 2\pi \frac{L_{\text{SQ}}I_{\text{circ}}}{\Phi_0}$$

$$\frac{I}{2} = \frac{\hbar C}{2e} \frac{d^2 \varphi_1}{dt^2} + \frac{\hbar}{2eR_N} \frac{d\varphi_1}{dt} + I_C \sin \varphi_1 + I_{\text{circ}}$$

$$\frac{I}{2} = \frac{\hbar C}{2e} \frac{d^2 \varphi_2}{dt^2} + \frac{\hbar}{2eR_N} \frac{d\varphi_2}{dt} + I_C \sin \varphi_2 + I_{\text{circ}}$$

(3.11)

によって記述される.ここで,簡単のため2つのジョセフソン接合のR, Cおよび I_c の値はループの左右で等しいとした.すなわち $R_N=R_1=R_2, C_J=C_2, I_c=I_{c1}=I_{c2}$ である.二つ目の式は,2つの接合の位相差の間にはループを貫く磁束によって加わる位相が付加されることを意味している.ここで, $\Phi_0=h/2e$ は磁束量子である.また, L_{SQ} はSQUID構造のループインダクタンスであり, I_{cire} はループ電流をあらわす.高感度なSQUIDの実現には,入力インダクタとの磁気的な結合を大きくする必要があるため,幾何学的に大きなループ構造の作製が不可欠であり,必然的に L_{SQ} は大きくなる.そのため実際のSQUID動作を議論するうえで,この項の影響を無視

することは出来ない.しかし,式(3.11)を解析的にと くことは難しく,多くはシミュレーションなどに頼って 最適な設計法が研究されている.そのため SQUID の基 本的な原理を理解するために $L_{SQ} = 0$ とし, RCSJ モデ ルと同様に $C_J = 0$ で近似した

$$I = I_{\rm C} \sin \varphi_1(t) + I_{\rm C} \sin \varphi_2(t) + \frac{2V}{R_{\rm N}}$$

= $2I_{\rm C} \cos \left(\pi \frac{\Phi_{\rm ext}}{\Phi_0}\right) \sin \varphi + \frac{2\hbar}{2eR_{\rm N}} \frac{d\varphi(t)}{dt}$ (3.12)
= $\widetilde{I}_{\rm C} (\Phi_{\rm ext}) \sin \varphi + \frac{\hbar}{2e\widetilde{R}_{\rm N}} \frac{d\varphi(t)}{dt}$

を考える.ここで

$$\varphi(t) = \varphi_1(t) + \pi \frac{\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}$$
(3.13)

によって新しい全体の位相を定義した.また, $\widetilde{R}_{N}=R_{N}/2$ である.この表式を式 (3.6)と比較すると,SQUIDの 電圧特性は磁束に依存する臨界電流

$$\widetilde{I}_{\rm C}(\Phi_{\rm ext}) = 2I_{\rm C}\cos\left(\pi\frac{\Phi_{\rm ext}}{\Phi_0}\right) \tag{3.14}$$

と \tilde{R}_N で I_c と R_N とを置き換えた単一接合のRSJモデルによって記述されることが分かる.RSJモデルにおける時間平均の式 (3.10)と同様に計算することによって,SQUIDの電流電圧特性

$$\langle V \rangle = R_{\rm N} \sqrt{I^2 - \tilde{I}_{\rm C}^2 (\Phi_{\rm ext})}$$
$$= 2I_{\rm C} R_{\rm N} \sqrt{\left(\frac{I}{2I_{\rm C}}\right)^2 - \left[\cos\left(\pi \frac{\Phi_{\rm ext}}{\Phi_0}\right)\right]^2}$$
(3.15)

が得られる. 図9(a)はこの関数を $\Phi_{ext}=n \Phi_0 \ge (n+1/2)$ Φ_0 に固定し VI 特性をプロットしたものである. $\Phi_{ext}=n \Phi_0$ 時は,単一のジョセフソン接合の電圧状態と同 様な振る舞いが観測されている.そして, $\Phi_{ext}=(n+1/2)$ Φ_0 では,臨界電流が実効的にゼロになるため,超伝導 のゼロ電圧状態が観測されなくなっている.この様に, 磁束の変化に伴って臨界電流が変わるため I を固定し た状態で,磁束が変化すると,それに応じて発生電圧は 変化する.実際,図9(b)はいくつかの I に固定して, <V>のΦ依存性をプロットしたものである. I> 2I_c で発 生電圧が周期的に振動しているが,特に I が 2I_c の直近 にセットされているとき,変化がもっとも急峻に起きて おり, SQUID の Φ -V変換効率が最もよくなっている. この様に,SQUID は Φ -V変換を行う素子であるから, その変換効率は,

$$H = \left| \frac{\partial V}{\partial \Phi_{ext}} \right| \tag{3.16}$$

によって記述することが出来る.変換効率が最大になる

のは, Φ_{ext} = (n+1/2) $\Phi_0/2$ の時で, かつIが $2I_{\text{C}}$ により近いときである.



図9 SQUID の等価回路と電流電圧特性.(a) ジョセフソン接合のRCSJ モデルに基づいた SQUID の等価回路.(b) SQUIDに流す電流Iによる発生電圧.(c)発生電圧の外部磁束依存性.グラフは下から,I/2I_c = 1.001, 1.01, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 と電流量を変えたもの.

SQUID の分解能を議論するうえで重要となるのは SQUID のループを貫く磁束雑音によって生じる電圧雑 音である.磁束の雑音強度スペクトル密度を S_{sq} とした 時,発生電圧雑音の雑音パワースペクトル密度は、

$$S_{V}(f) = H^{2}S_{SO}(f) \tag{3.17}$$

で与えられる.また SQUID の文脈では,電圧雑音より もそれをエネルギーに換算した量が用いられることが多 く,

$$\varepsilon(f) = \frac{S_{\rm SQ}(f)}{2L_{\rm SQ}} = \frac{S_V(f)}{2L_{\rm SQ}H^2}$$
(3.18)

で与えられるように、SQUIDのループインダクタン ス L_{sq} を用いてエネルギーに換算した量が用いられる. SQUID は通常磁気シールドを施して外来磁気雑音の影 響がないような環境で使用されるので、SQUIDの磁束 雑音の起源としては外来の雑音と言うよりは、SQUID 自身で発生する電流雑音に伴う磁束の揺らぎが主であ る.例えば、接合に付随する常伝導抵抗成分では、散逸 のため発生するジョンソン・ナイキスト雑音(熱雑音) が支配的な雑音源と考えられており、シミュレーション などによるパラメータの最適化を行った研究によると、

$$\mathcal{E}(f) = \frac{S_V(f)}{2L_{\rm SQ}H^2} = \frac{9k_{\rm B}TL_{\rm SQ}}{R_{\rm N}} = \frac{9k_{\rm B}T\Phi_0}{2I_{\rm C}R_{\rm N}}$$
(3.19)

で見積もることが出来る 5),6),32).

3.1.2 SQUID の測定回路

SQUID を用いた電流の測定に関して説明する.前節, 図9で説明したように,SQUIDのV-Φ曲線には,Φ -V変換効率を最大化できる適切なバイアスポイントが 存在することに加え,非線形な形をしており大きなΦの 変化があった時に,バイアスポイントから外れてしまっ てゲインが非線形に変化してしまう.これを補正して, 適切なバイアスポイントに保ちつつ測定するための機構 として,フラックスロックドループ(FLL)が用いられ る.

図 10(a) に典型的な FLL の測定セットアップを図 示した.SQUID は Φ -V変換を行うものであるので、入 力は磁束である.SQUID ループはデバイス上に作りこ まれているため, 直接磁束をここに通すわけには行か ず,ピックアップコイルによって電流信号 Isig へといっ たん変換し、それを SQUID と結合したコイルを介して 磁束へと変換し SQUID の測定が出来る. また, SQUID には磁束を適当なバイアスポイントに調整するための フィードバックコイルが設けられており、ここに室温の 測定器から直流電流を流すことによってオフセットの 磁束を追加する.さらに磁束によるバイアスポイントの ずれを補正するための機構として, 方形波発振器からの 磁東変調をかけ、電圧出力のロックイン出力をフィード バックコイルに戻すようになっている.通常,方形波と しては,数百kHzから数MHz程度の帯域が利用される. この動作を理解するために,2つの異なる磁束バイアス ポイントで方形波による変調を加えた時の電圧出力の様 子を図(b)に示している.(a)は $\Phi_{ext}=n\Phi_{0}$ をオフ セット,入力信号がゼロ Isig=0の時,その周りで変調を かけた様子を表している.このポイントでは,磁束は左 右対称な2点間で変調を行うため出力電圧は常に一定 であり、したがってロックインの出力はゼロである.-方(β)は $I_{sig} \neq 0$ の時を示すが,有限の I_{sig} のために, 磁束による変調は左右非対称に印加され,その結果出力 も変調信号に同期した方形波になる.この時ロックイン の出力は有限の値である. ロックインの出力はフィード バック抵抗を介して電流へと変換され,出力がゼロにな る(すなわち磁束の変調が対象になる)ようにフィード バックがかかる.このフィードバックによって SQUID を常に設定したバイアスポイントの周りで動作するよう

に制御し,入力磁束に大きな変化があった場合でも常に その変化を自動的に補正して測定することが可能にな る.



図10 フラックスロックドループ(FLL)による SQUID 測定.(a) FLLの測定回路.点線で囲った領域が低温に冷却される部分.(b) FLLの動作概念図.2種類の方形波変調を Φ ext として与えた場合の SQUID の電圧 V.(a) 信号電流 $I_{sig}=0$ の時.対象に変調されるため出力電圧はゼロ.(β) 信号電 流 $I_{sig} \neq 0$ の時.信号電流による磁束のオフセットがある ため,非対称に変調され,方形波上の電圧信号が出力され る.

3.2 極低温電流比較器(CCC)

3.2.1 CCC の原理

2種類の巻き数の違うコイルを結合させることによっ て,電流や電圧を巻き数比に応じて変換することが出来 る.しかし、実際にコイルを巻いて作られる変圧器は、 磁束漏れのために,変換比は正確には巻き数比と一致し ない. 極低温電流比較器(CCC)は, 超伝導体の持つ完 全反磁性の性質を利用して,巻き数比に応じて精密に電 流を増幅できる機構である³³⁾. CCCの原理を理解する ために,図11のような構造を考える.超伝導体で出来 たチューブに2つの電流が流れているとする. それぞれ の電流を I1, I2とする. 超伝導体は, 内部の磁場がゼロ になる完全反磁性の性質を持つ.この現象は、超伝導体 の表面に遮蔽電流が流れることによって,超伝導体内へ の磁束の進入を打ち消していることによって起こる(マ イスナー効果).図に示したチューブの場合,遮蔽電流 I はチューブの内側から側面を通って外側へ回り込む.ア ンペールの法則によると,チューブの超伝導体内を通る 図中の円aに沿って磁束密度の線積分を行うと,超伝導 体内で磁場がゼロなので.



図11 超伝導遮蔽電流の概念図.超伝導体でできたチューブの中 を2本の電流 I₁, I₂ が流れる時,超伝導の完全反磁性の性質 によって表面に遮蔽電流 I=-(I₁+I₂)が発生する.

$$\mu_0(I_1 + I_2 - I) = \oint_a B \cdot dl = 0 \tag{3.20}$$

が成り立つ.そのため,遮蔽電流は

$$I = I_1 + I_2 (3.21)$$

のように,2つの電流の和で与えられる.この考えを一 歩推し進めて, I_1 の電流が N_1 回, I_2 の電流が N_2 回逆向 きに流れていたとすると,そのときの遮蔽電流は,

$$I = N_1 I_1 - N_2 I_2 \tag{3.22}$$

である.すなわち遮蔽電流がゼロ*I*=0となるとき,2つの電流は,

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1 \tag{3.23}$$

の関係でバランスする.図11のような円筒状の形状で この原理を実装することは困難であり、実際には、図12 に示したようなトロイダル状のコイルに超伝導体を巻 きつけて作られる.超伝導体で発生する遮蔽電流は、ト ロイダルチューブの表面を流れ,そのときにチューブの 外側に磁場を発生させる.この外部磁場はピックアッ プコイルを介して SQUID で読み出され, 遮蔽電流の検 出が出来る.電流増幅器として使用する場合には,増幅 したい微小電流を I1 に流し, SQUID の出力信号がゼロ になるようにフィードバック電流を I2 として流すこと によって巻き数比による正確な電流増幅が可能になる. 電流増幅決めているのは, SQUIDの磁束検出効率であ り、したがって低雑音な SQUID を採用することに加え、 SQUID と CCC の間の結合を出来るだけ高効率にする ことが必要である.図12では、内部構造を説明するた めにトロイダルチューブを一部開放しているが,実際に

は磁束漏れがないようにオーバーラップさせる(その形 状は,「自分の尻尾に噛み付いた蛇」と比喩される).



図12 実用的な CCC の構造、異なる巻き数比 N₁N₂のコイルが超 伝導体のトロイダル状のチューブで囲まれており、各コイ ルには逆向きに電流が流れる、トロイダルチューブに発生 する遮蔽電流をチューブに沿って配置したピックアップコ イルによって検出し、SQUID を利用して高精密に測定する。 2つのコイルを流れる電流が巻き数比に応じてつりあった 時、遮蔽電流がゼロになり、SQUID の出力もゼロとなる。

3.2.2 CCC の設計

CCC の電流増幅の精度は,QMT 実験を行う上で最終 的な不確かさの大きな要因となるため,重要である.本 節では,CCC の形状やピックアップの形状がどのように 電流増幅の精度に結びつくかをまとめる(文献参照^{6).} ^{33),34)}.図13(a)にCCC,SQUIDおよびそれらを接 続するピックアップコイルの等価回路を図示した.*I*が CCC の超伝導トロイダルチューブ上を流れる遮蔽電流 であり, L_{ccc} はチューブ自身の自己インダクタンスであ る. L_{p} はピックアップコイルの自己インダクタンスであ る. L_{p} はピックアップコイルとトロイダルチューブ の間の相互インダクタンスであり $M=N_{p}L_{ccc}$ である.同 様に, L_{i} はSQUIDの入力インダクタンスであり, M_{i} で SQUID ループと結合している. L_{sq} はSQUID ループ 自身の自己インダクタンスである.

ここで, *L*_{ccc} は CCC トロイダルの幾何学的形状から 見積もることが可能である:

$$L_{\text{CCC}} \cong \mu_0 a \left| \ln(8a/r) - 2 \right| \tag{3.24}$$

ここで, $r = \sqrt{WH/\pi}$ であり各パラメータは図 13 (b) で 定義されている.一方ピックアップコイルは,図 12 お よび 13 (b) に示されるように,トロイダルチューブの 内側にぴったり沿った巻き数 N_p のソレノイド型のコイ ルである.自由空間であれば,ソレノイドの自己インダ クタンスの公式から L_p の値は導かれるはずであるが,



図13 CCC・SQUID 結合.(a) SQUID による読み出しを使用した CCC の等価回路.(b) CCC のトロイダルチューブの断面とピックアップコイル.

超伝導体であるトロイダルチューブの表面近くにぴっ たりと巻きつけてあるため、そこからの磁気遮蔽効果に よってソレノイド本来の値からは大幅に修正され、

$$L'_{\rm p} \cong L_{\rm p}(1-k') + kN_{\rm p}^2 L_{\rm CCC}$$
 (3.25)

で近似される.第一項は, L_p をソレノイド本体の自己イ ンダクタンスとした時に,遮蔽によってどの程度インダ クタが小さくなるかを与える式であるが,実際にはほと んど $k'\cong1$ であり,コイル自身の自己インダクタンスは ほとんど遮蔽されてしまって見えなくなることを意味す る.第2項は,その遮蔽によって新しく生み出されるイ ンダクタンス成分である.ここで,kはピックアップコ イル半径b,コイルとトロイダルチューブの隙間d[図 13(b)参照]の関数として, $k\cong1-d/b$ で近似されるが, ピックアップコイルはトロイダルチューブに出来るだけ 近づけることによって高い変換を得るように作製される ものなので,通常この値はほとんど1である.したがっ て,ピックアップコイルの自己インダクタンスは

$$L_{\rm p}' \cong N_{\rm p}^2 L_{\rm CCC} \tag{3.26}$$

で近似できる.次に,相互インダクタンスと磁束,電流の関係から

$$IM = I_{in}(L_p + L_i),$$
 (3.27)

$$I_{\rm in}M_{\rm i} = \Phi_{\rm SQ} \tag{3.28}$$

がそれぞれ成り立つ.ここで, Φ_{sq} はピックアップコイ ルによって作られる SQUID への磁束入力を表す.これ らに基づいて,この回路のエネルギー変換効率 I_{ccc} を次 のように導入する.

$$I_{\rm CCC} = \frac{\sqrt{\frac{1}{2}L_{\rm i}I_{\rm in}^2}}{\sqrt{\frac{1}{2}L_{\rm CCC}I^2}}$$
(3.29)

これは, CCC トロイダルチューブとピックアップコイ ルそれぞれで発生した磁東エネルギーの平方根の比を とったものである.ここに,式(3.26),(3.27)を代入し,

$$I_{\text{CCC}} = \frac{I_{\text{in}}}{I} \sqrt{\frac{L_{\text{i}}}{L_{\text{CCC}}}} = \frac{N_{\text{p}} L_{\text{CCC}}}{N_{\text{p}}^{2} L_{\text{CCC}} + L_{\text{i}}} \sqrt{\frac{L_{\text{i}}}{L_{\text{CCC}}}} = \frac{N_{\text{p}} \sqrt{L_{\text{CCC}} / L_{\text{i}}}}{\left(N_{\text{p}} \sqrt{L_{\text{CCC}} / L_{\text{i}}}\right)^{2} + 1}$$
(3.30)

を得る.ここで $M=N_pL_{ccc}$ を用いた.この表式は, $L'=N_p^2L_{ccc}=L_1$ の時,最大値 $I_{ccc}=1/2$ をとる.この時の ピックアップコイルの最適な巻き数は、

$$N_{\rm p}^{\rm opt} = \sqrt{\frac{L_{\rm i}}{L_{\rm CCC}}} \tag{3.31}$$

であり,実際にはこれに一番近い整数でコイルを巻くこ とになる.電気回路でよく知られているように,2つの 回路のインピーダンス整合を取ることによって両者の エネルギー伝達効率が最大化される.式(3.30)の結論 は,ピックアップコイルの巻き数を変えることによって CCCと SQUIDの間でインピーダンス整合を取り,伝 達効率を最大化させたことに対応する.この時の CCC の変換効率を評価する量として電流磁束変換比,

$$g_{\rm CCC} = \left| \frac{\partial \Phi_{\rm SQ}}{\partial I} \right|^{-1} = \frac{2}{N_{\rm p}^{\rm opt} M_{\rm i}}$$
(3.32)

が定義される.この量は通常単位 A・turn/ Φ_0 によって CCC の性能評価に用いられる(表1参照).

CCC の精度を見積もるために,この回路で発生する 電気的な雑音評価することが必要である.雑音の起源と しては,外部からの磁束雑音(そのパワースペクトル強 度を S_{ϕ ,ext} とする)と SQUID 自身が出している雑 音 (S_{sq})である.それらの寄与による雑音は,CCC の 入力換算電流雑音(S_{LCC})と,

$$S_{I,\text{CCC}} = \left(\frac{S_{\text{SQ}}}{M_{\text{SC}}^2} + \frac{S_{\Phi,\text{ext}}}{L_{\text{CCC}}^2}\right) / N_{\text{CCC}}$$
(3.33)

によって結ばれている.ここで, $N_{\rm ccc}$ (= N_1/N_2) はコ イルの巻き数比であり CCC の電流増幅率に対応する. また差最適化された条件下では,SQUID と CCC コイ ル間の相互インダクタンス $M_{\rm sc}$ は,

$$M_{\rm SC} = \frac{M}{L'_{\rm p} + L_{\rm i}} M_{\rm i} = \frac{M_{\rm i}}{2N_{\rm p}^{\rm opt}} = \frac{k_{\rm SQ}\sqrt{L_{\rm i}L_{\rm SQ}}}{2N_{\rm p}^{\rm opt}} = \frac{k_{\rm SQ}}{2}\sqrt{L_{\rm SQ}L_{\rm CCC}}$$
(3.34)

である.ここで、 k_{sq} は SQUID のループと入力コイルの間の結合定数であり、 $M_i = k_{sq} \sqrt{L_i L_{sq}}$ で定義されている.したがって、

$$S_{I,\text{CCC}} = \left(\frac{4S_{\text{SQ}}}{k_{\text{SQ}}^2 L_{\text{SQ}} L_{\text{CCC}}} + \frac{S_{\Phi,\text{ext}}}{L_{\text{CCC}}^2}\right) / N_{\text{CCC}}$$

$$= \left(\frac{8\varepsilon}{k_{\text{SQ}}^2 L_{\text{CCC}}} + \frac{S_{\Phi,\text{ext}}}{L_{\text{CCC}}^2}\right) / N_{\text{CCC}}$$
(3.35)

が導かれた.より高精度な電流精度を得るためには,ま ず $N_{\rm CCC}$ を大きくすること,次に低雑音な SQUID の採 用,および大きなインダクタンス $L_{\rm CCC}$ を持つようにト ロイダルコイルの設計を行うことが重要であることが分 かる.そして外部磁場を遮蔽することによってより低雑 音な CCC が実現できることを意味している.

3.3.3 CCC の実装

前節で紹介した設計事例に基づいて,実際の CCC の 実装例を簡単に紹介する.現在では QMT の実現を念頭 に置いて,巻き数比1万以上の CCC が作製され,いく つかの報告がある.図14はそのような CCC の実験セッ トアップの1例である.前節最後に述べたように,CCC の雑音源の一つである外来磁束雑音の影響を出来るだ け小さくするため, CCC と SQUID のセットアップを3 重の磁気シールドで覆っている.外側は透磁率の大きな ミューメタル系の磁気シールドであり、その内側に超伝 導体の完全反磁性を利用する2重の鉛シールドで覆わ れている.また,その内側に置かれている SQUID はさ らに転移温度の高いニオブでシールドされている.CCC の感度を高めるには、トロイダルチューブのインダクタ ンスLcccを大きく設計する必要がある.しかし,磁気 シールドと CCC の隙間を狭くしすぎると,磁気シール ドによる遮蔽効果でLcccの値が減少する.そのため低 温測定用のデュワーの径の許す限り磁気シールドの内径 を大きくとることが望ましい.磁気シールド壁を考慮し たL_{CCC}の値に関しては, 文献³³⁾ に詳しく記述されてい る.

1万を超える巻き数の CCC コイルは数ヘンリーに達 する自己インダクタンスを持つため,配線の浮遊容量と の間でL C 共振回路を作ってしまいノイズを増幅してし まう.このため,高巻き数の CCC 作製においては,共 振を抑える工夫が必要である.初期の高巻き数 CCC で は,配線抵抗による発熱を抑えるため NbTi などの超伝 導線を巻いて作られていたが,損失の少ない超伝導線は 高い Q 値の LC 共振を持ち,共振周波数の周りで強い雑 音ピークを発生させてしまうと言う問題があった.この 問題を回避するために,最近の研究³⁶⁾では抵抗の大き な CuNi 線を用いることによって,意図的に Q 値を下 げる工夫をした CCC が開発されている.この研究では, 異なる巻き数比のコイル間にもシールドのための金属箔 を挿入し寄生容量の影響を小さくしている.

CCC はコイルの巻き数で電流比が決まる構造である が、トロイダルチューブの隙間から磁束漏れがあった場 合などに、比に誤差が生じることがある⁴².そのため、 出来上がった CCC は,巻き数比の正確さを評価する必 要がある.その評価には,ビルドアップテストが用いら える.例えば,巻き数比3万の CCC の場合,コイルの 巻き数として1,1,2,4,10,10,20,20,40,40,100,100, 200,400,400,1000,2000,4000,4000,10000,10000 のものを一つの CCC の中に作りこんでおく.初めに1:1 のコイルに同じ電流を逆向きに流すことによって,この ペアがつりあっていることを検証する.次に2本の1回 巻きコイルを直列につなぎ,1+1のコイルにして,2回 巻きコイルとの間で釣合を評価する.この釣合検証を最 終的に10000回巻きコイルに至るまで繰り返すことに よって,CCC の巻き数比の精度を評価できることにな る.



図14 CCCの実験装置模式図.地磁気などによる磁場の影響を完全に遮断するためパーマロイ等の磁気シールドと超伝導体の完全反磁性を利用する超伝導磁気シールドによる多重の磁気シールドに収めて使用する.超伝導体の性質を利用するため、シールド全体を液体ヘリウム(42 K)で冷却して測定を行う.図は文献⁴⁰を参考にした.

これまでに報告されている巻き数比1万クラスの CCCの感度,入力換算雑音を表1にまとめた.高巻き 数比のコイル作製と低雑音 SQUIDの採用により,より 小さな入力換算電流雑音 S_{LCCC}を達成できている様子が わかる.

表1 巻き数比1万クラスの CCC の比較

文献	巻き数比	${ m S}_{ m I,CCC}$ [fA/Hz0.5]	g_{ccc} $[\mu A \cdot turn / \Phi_0]$	$\begin{array}{c}S_{SQ}\\ [\mu ~\Phi ~_0\!/Hz^{0.5}]\end{array}$
Gay et al. $^{37)}$	1:10000	4	5.0	6
Elmquist et al. $^{38)}$	2:15496	10.7	3.75	5
Devoille et al. $^{\scriptscriptstyle 31)}$	1:20000	3	5	3.1
Rietveld et al. $^{\rm 40)}$	1:30000	2.1	2.3	15
Janssen et al. $^{\rm 41)}$	1:40960	0.5	10.7	3.2

3.3.4 CCC-SQUID 読出しを用いた量子メトロロジー トライアングルの展望

最後に、これまでに記述した SQUID および CCC を 用いた QMT 実験への展望として、QMT 実験を構成す る回路要素における電気的な雑音を解析し、電気的な 雑音を起源とした QMT 実験の不確かさに関して考察 する.図15(a)に、CCC を電流増幅器として用いる QMT 実験のセットアップを示した.SET からの量子電 流 I_{SET} を増幅率 N_{CCC} で増幅し、量子ホール素子(抵抗 R_{H})へと流す.この時の発生電圧をジョセフソン素子の 発生電圧と NULL 検出器によって比較する.図(b)は 等価的な雑音回路であり、 δ を冠した記号は各構成要素 で発生する電流雑音、電圧雑音に対応する.このうち大 きな寄与を持つのは CCC で発生する電流雑音であり、 もう一つは NULL 検出器の雑音である.また、 R_{CCC} は CCC1 次側コイルの入力抵抗である.



図15 量子メトロロジートライアングル実験の等価雑音回路.

 (a)量子メトロロジートライアングル実験を模式的に表した回路図.ジョセフソン素子や単一電子トランジスタ素子
 (SET)を駆動するマイクロ波発生装置類などは省略されている.
 (b)等価雑音モデル. δを付した記号はトライアングルを構成する各素子で発生する電流,電圧雑音を表す.

前節までで述べた, CCC の電流雑音は, 単位周波数で 規格化された雑音密度である.実験で得られる電流揺ら ぎの大きさ (δI_{ccc})²は, $S_{I,ccc}$ を測定周波数帯域で積 分した,

$$(\delta I_{\rm CCC})^2 = \int_{0}^{f_2} S_{\rm I,CCC} df$$
(3.36)

によって与えられる. f_1, f_2 はそれぞれ測定帯域の下端, 上端であるが, SQUID の 1/f 雑音などを避け, 雑音がほ とんど白色雑音と見なせる 0.1-0.5 Hz 近傍で測定され ることが多い.QMT で電圧信号として出てくるのは、

$$V_{\rm OMT} = R_{\rm H} N_{\rm CCC} I_{\rm SET} \tag{3.37}$$

である.一方,同時に発生する全雑音成分は,

$$(\delta V_{\text{OMT}})^2 = 4k_{\text{B}}T_{\text{H}}R_{\text{H}} + (\delta I_{\text{CCC}})^2 R_{\text{H}}^2 + (\delta V_{\text{NULL}})^2 + (\delta V_{\text{J}})^2$$

(3.38)

によって与えられる.第1項は,量子ホール素子の熱雑 音である.第2項は CCC の電流雑音が量子ホール素子 に流れ込んだときに発生する電圧雑音であり,第3項は NULL 検出器の電圧雑音である.最後の第4項はジョ セフソン接合で発生する電圧雑音を表す.これらから信 号雑音比の2乗

$$(\text{SNR})^{2} = \frac{(\delta V_{\text{QMT}})^{2}}{V_{\text{QMT}}^{2}} = \frac{4k_{\text{B}}T_{\text{H}}R_{\text{H}} + (\delta I_{\text{CCC}})^{2}R_{\text{H}}^{2} + (\delta V_{\text{NULL}})^{2} + (\delta V_{\text{I}})^{2}}{(R_{\text{H}}N_{\text{CCC}}I_{\text{SET}})^{2}}$$
(3.39)

が得られることになる.

現実に見合ったいくつかの実験条件を仮定して,実際 にどの程度の値になるかを見てみよう.量子ホール素子 は,0.3 Kの冷凍機中においていたとすると,発生する 熱雑音は 0.46 nV/Hz^{0.5} 程度である. 第2項の CCC 雑 音としては, L_{ccc} = 30 nH, マグニコン社から販売され ている SQUID の ε = 45 h を用いるとする⁴²⁾. N_{ccc} = 10000として,式(3.35)からCCCの出力側で2.8 pA/ Hz^{0.5}相当の電流雑音が発生する.この雑音値は, N_{ccc} で割って入力に換算すると 0.28 fA/ Hz^{0.5} であり表1の 先行研究の値よりかなり優れていることがわかる.理由 のひとつは、今回参照した SQUID の雑音レベルが市販 のものとしては最高クラスの $0.8\mu \Phi_0/Hz^{0.5}$ であり,従 来の研究よりも高感度なためである.多くの先行研究 で, 実際に CCC を作製すると CCC - SQUID 間でイン ピーダンス整合が理想的でないことなどによって, その 感度は式(3.35)による見積もりと比較して2,3倍程 度悪化する.ここでの試算では,2.5倍して得られる0.7 fA/ Hz^{0.5}を CCC の入力換算電流雑音であると仮定する. また, NULL 検出器の電圧雑音としては, 文献値¹⁹⁾か ら 5 nV を仮定する.ジョセフソンからの雑音やその他 CCC コイルの抵抗から来る熱雑音はこれらに比べると 無視できる程度である.そして測定の周波数帯域として は, $\Delta f = 0.5$ Hz とする.SET 電流としては,チューナ ブルバリア方式の単一電子転送で現在最も高い精度が得 られている値 $I_{SET} = 80$ pA (文献値²⁴⁾)を用いると,信 号雑音比として SNR = 4.3×10^{-6} が得られる.実際の 実験では,統計的に独立な測定を繰り返すことによって 平均をとり不確かさを小さくする.統計平均による不確 かさは,

$$u_I = \frac{SNR}{\sqrt{N_{\rm rep}}} \tag{3.40}$$

によって見積もることが出来る.ここで N_{rep} は繰り返 し回数である.今の見積もりでは QMT 実験の精度を7 桁以上にするためには $N_{rep} > 1850$ 回であればよく,一 回の測定は大体1分以内で終了するため,31時間程度 の積算時間で目標を達成できる試算であり現実的と言 える.さらにもう一桁精度を高めた8桁精度を目指すな らば,約130日間の積算が必要になる.これは不可能と は言えないが,より実用的な時間内で収束させるために CCC の巻き数を増やすことで電流増幅率を改善し,信 号雑音比を改善するほうが賢明である.

4 結論

本調査研究では,電気標準に用いられる3つの量子現 象, すなわち量子ホール効果, ジョセフソン効果, 単一 電子トンネリング効果を組み合わせて行う QMT 実験に 関して調査を行った.特に,現状の量子電流では生成で きる電流値が高々数百ピコアンペア程度であることか ら,SI 改定などで求められる7桁精度を達成するため には精密な電流増幅を利用する実験セットアップが必要 になる.特に極低温電流比較器 (CCC) と SQUID によ る検出方法を用いるトライアングル実験が有望視されて いる.本報告書では, SQUID と CCC の基本原理を記述 し、特に QMT 実験で不確かさの原因となる電気的な雑 音に関し詳しく記述した.それらの知見をもとにした見 積もりでは,1万以上の巻き数比を有する CCC を利用 することで現実的な積算時間で目標である7桁精度に到 達可能であるという試算を得た.これらの知見は,今後 高精度な QMT 実験セットアップを構築するうえで重要 な指針を与えると思われる.QMT 実験の高精度なデモ ンストレーションによって新 SI に向けた整合性の検証 実験に寄与することで、高精密な計測技術のもとに成り 立っている現代の産業界などへ貢献することが出来る.

謝辞

本調査研究を行うにあたり物理計測標準研究部門の金 子晋久様,浦野千春様,浦野千春様,堂前篤志様,丸山 道隆様,大江武彦様,中村秀司様には有益な情報をいた だきました.また報告書に関してコメントを頂いた山田 善郎様に感謝いたします.

参考文献

- 遠藤 忠,新しい電気の量子標準-ジョセフソン 効果電圧標準と量子ホール効果抵抗標準-,応用物理 59-6,712 (1990).
- 2) M. W. Keller, Metrologia 45 102 (2008) .
- H. Scherer, B. Camarota, Meas. Sci. Technol. 23, 124010 (2012) .
- 4) N. Kaneko and T. Oe, Quantum metrology Triangle, 応用物理 83, 5 (2014) .
- 5) The SQUID Handbook, vol.1 Edited by J. Clarke and Alex I. Braginski, Wiley-vch (2004) .
- The SQUID Handbook, vol.2 Edited by J. Clarke and Alex I. Braginski, Wiley-vch (2006).
- 7) P. J. Mohr, B. N. Taylor, and D. B. Newell, CODATA 2010, Rev. Mod. Phys. 84, 1527 (2012) .
- 24th meeting of the General Conference on Weights and Measures (2011) available at http:// www.bipm.org/en/CGPM/db/24/1/.
- C. A. Hamilton, Rev. Sci. Instrum. 71, 3611 (2000) .
- 10) 丸山道隆, 産総研計量標準報告 8, 263 (2011).
- R. Behr, H. Schulze, F. Muller, J. Kohlmann, and J. Niemeyer, IEEE Trans. Instrum. Meas. 48, 270 (1999) .
- B. Jeanneret, A. Rufenacht, and C. J. Burroughs, IEEE Trans. Instrum. Meas. 50, 188 (2001) .
- 13) J.-S. Tsai, A. K. Jain, and J. E. Lukens, Phys. Rev. Lett. 51, 316 (1983) .
- A. K. Jain, J. E. Lukens, and J.-S. Tsai, Phys. Rev. Lett. 58, 1165 (1987) .
- W. Poirier and F. Schopfer, Eur. Phys. J. Special Topics 172, 207 (2009) .
- 16) A. Hartland, K. Hones, J. M. Williams, B. L. Gallagher, and T. Galloway, Phys. Rev. Lett. 66, 969 (1991) .

- B. Jeckelmann and B. Jeanneret, Rep. Prog. Phys. 64, 1603 (2001) .
- 18) B. Jeckelmann, B. Jeanneret, and D. Inglis, Phys. Rev. B 55, 13124 $\left(1997\right)$.
- T. J. B. M. Janssen, J. M. Williams, N. E. Fletcher, R. Goebel, A. Tzalenchuk, R. Yakimove, S. Lara-Avila, S. Kubatkin, and V. I. Fal'ko, Metrologia 49, 294 (2012) .
- K. S. Novoselov, Z. Jiang, Y. Zhang, S. V. Morozov, H. L. Stormer, U. Zeitler, J. C. Maan, G. S. Boebinger, P. Kim, A. K. Geim, Science 315, 5817 (2007).
- 21) F. Guinea, M. I. Katsnelson, and A. K. Geim, Nat. Phys. 6, 30 (2010) .
- N. Levy, S. A. Burke, K. L. Meaker, M. Panlasigui, A. Zettl, F. Guinea, A. H. Castro Neto, M. F. Crommie, Science 329, 544 (2010).
- 23) 中村 秀司, 產総研計量標準報告 vol8, 441 (2013).
- 24) M. Seo, Y.-H. Ahn, Y. Oh, Y. Chung, S. Ryu, H.-S. Sim, I.-H. Lee, M.-H. Bae, and N. Kin, Phys. Rev. Lett. 90, 085307 (2014) .
- 25) M. W. Keller, A. L. Eichenberger, J. M. Martinis and N. M. Zimmerman, Science, 10, 1706 (1999) .
- 26) M. W. Keller, N. M. Zimmerman , and A. L. Eichenberger, Metrologia 44 505 (2007) .
- 27) J. R. Williams, R. N. Ghosh and J. M. Martinis, J. Res. Nat. Inst. Stand. Technol. 97 299 (1992) .
- 28) M. W. Keller, J. M. Martinis, N. M. Zimmerman, and A. H. Steinbach, Appl. Phys. Lett. 69, 1804 (1996).
- H. Scherer, S. V. Lotkhov, G-D. Willenberg and
 B. Camarota, IEEE Trans. Instrum. Meas. 58, 997 (2009) .
- B. Camarota, H. Scherer, M. W. Keller, S.
 V. Lotkhov, G-D. Willenberg and F. J. Ahlers, Metrologia 49, 8 (2012) .
- L. Devoille, N. Feltin, B. Steck, B. Chenaud, S. Sassine, S. Djordevic, O. Séron, and F. Piquemal, Meas. Sci. Technol. 23, 124011 (2012) .
- R. Gross and A. Marx, Applied Superconductivity Josephson Effect and Superconducting Electronics, Walther-Meißner-Institut (2005) .
- 33) B. Porcar, M. Elena, Cryogenic current comparators with optimum SQUID readout for current and resistance quantum metrology, thesis

University of Twente $\left(2002\right)$.

- 34) J. Sesé, A. Camon, C. Rillo, and G. Rietveld, IEEE Trans. Instrum. Meas. 48, 1306 (1999) .
- 35) J. Sesé, E. Bartolomé, A. Camó, J. Flokstra ,
 G. Rietveld, and C. Rillo, IEEE Trans. Instrum.
 Meas. 48, 1306 (1999) .
- 36) G. Rietveld, P. de la Court, and H. E. van den Brom, IEEE Trans. Instrum. Meas.58, 1196 (2009) .
- 37) F. Gay, F. Piquemal, and G. Genevès, Rev. Sci. Instrum. 71, 4592 (2000) .
- R. E. Elmquist, E. Hourdakis, D. G. Jarrett, and
 N. M. Zimmerman, IEEE Trans. Instrum. Meas.
 54, 525 (2005) .
- 39) N. Feltin, L. Devoille, F. Piquemal, S. V. Lotkhov, and A. B. Zorin, IEEE Trans. Instrum. Meas. 52, 599 (2003) .
- 40) G. Rietveld, E. Bartolomé, J. Sesé, P. de la Court, J. Flokstra, C. Rillo, and A. Camón, IEEE Trans. Instrum. Meas. 52, 621 (2003) .
- 41) T. J. B. M. Janssen, and A. Hartland, Physica B 284-288, 1790 (2000) .
- 42) H. Seppä, IEEE Trans. Instrum. Meas. 39, 689 (1990) .
- 43) D. Drung, C. Aßmann, J. Beyer, A. Kirste, M. Peters, F. Ruede, and Th. Schurig, IEEE Trans. Appl. Supercond. 17 (2007) .